

## ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ ВЫПУСКА

С 9 по 13 сентября 2002 года в г. Новосибирске проходил 7-й Международный симпозиум по лазерной метрологии – LM-2002. Симпозиум проведен по инициативе Международной конфедерации по измерениям (ИМЕКО) под эгидой Технического комитета по измерениям геометрических величин (ТС-14).

Первая тематическая подборка статей по докладам Симпозиума опубликована в нашем журнале в 2003 г. (см. «Автометрия», 2003, том 39, № 5); вторая предлагается в настоящем выпуске. Статьи посвящены актуальным современным проблемам развития нанотехнологий и высокоточных измерительных систем для научных и промышленных применений.

В разделе «Нанотехнология, нанометрия» представлены взгляды специалистов на развитие нанотехнологий в полупроводниковой электронике, измерительной технике и дифракционной оптике.

В разделе «Информационно-измерительные системы» рассматриваются вопросы создания новых оптических измерительных приборов и систем технического зрения, предназначенных для измерения скоростей, геометрических размеров, шероховатости поверхностей и других параметров объектов.

Материалы данного выпуска могут быть интересны специалистам, работающим в областях нанотехнологий и оптических измерений.

*Д-р техн. наук Ю. В. Чугуй*